(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-277456

(43)公開日 平成9年(1997)10月28日

(51) Int.Cl. ⁶		戲別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
B 3 2 B	27/00			B 3 2 B	27/00	Z	
	27/28	102			27/28	102	
	27/32				27/32	Z	

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 15 頁)

		水即正母	未開水 開水項の数8 UL (全 15 貝)			
(21)出願番号	特顧平8-91551	(71) 出願人 000231682				
			日本石油化学株式会社			
(22)出顧日	平成8年(1996)4月12日		東京都千代田区内幸町1丁目3番1号			
		(72)発明者	若山 昌弘			
			神奈川県川崎市川崎区夜光2-3-2 日			
			本ポリオレフィン株式会社川崎研究所内			
		(72) 発明者				
			神奈川県川崎市川崎区夜光2-3-2 日			
			本ポリオレフィン株式会社川崎研究所内			
		(72)発明者	丸山 敏			
			神奈川県川崎市川崎区夜光2-3-2 日			
			本ポリオレフィン株式会社川崎研究所内			
		(74)代理人				

(54) 【発明の名称】 積層体

(57) 【要約】

【課題】 衝撃強度、突刺強度、低温ヒートシール性、 ヒートシール強度、夾雑物ヒートシール性等のヒートシ ール特性、ホットタック性、成形時のネックイン、ドロ ーダウン等の成形性などに優れた積層体。

【解決手段】 基材層からなる第1層とパリヤー性材料層からなる第11層及びシーラント層からなる第111層で構成される積層体であって、シーラント層が下記エチレン系樹脂組成物からなる。シウロペークタリンドではエチレンとはエチレンと炭素数3~20のαーオレフィンとを重合させて得られ、密度が0.86~0.96g/cm³、メルトフローレート0.1~100g/10分、分子量分布(Mw/Mn)が1.5~5.0、組成分布パーラメーターCbが2.00以下の要件を満足するエチレン単独重合体又はエチレン・αーオレフィン共重合体98~20重量%と、他のエチレン系重合体2~80重量%を含む。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基材層からなる第1層とパリヤー性材料 層からなる第11層およびシーラント層からなる第111層 で少なくとも構成される積層体であって、該シーラント 層が下記エチレン系樹脂組成物からなることを特徴とす る積層体。

[エチレン系樹脂組成物]

(A) 少なくともシクロペンタジェン化合物、周期律表 第IV族の遷移金属化合物を含む触媒の存在下にエチレン またはエチレンと炭素数3~20のα-オレフィンとを (共) 重合させることにより得られる

(a 1) 密度がO. 86~O. 96g/cm³、

(a2) メルトフローレートO. 1~100g/10

(a3) 分子量分布 (Mw/Mn) が1.5~5.0、 (a4)組成分布パラメーターCbが2.00以下の要 件を満足するエチレン単独重合体またはエチレン・αー

オレフィン共重合体98~20重量%と、 (B) 他のエチレン系重合体2~80重量%を含む樹脂 組成物。

【請求項2】 前記の(A) エチレン単独重合体または エチレン・αーオレフィン共重合体が、シクロペンタジ エニル骨格を有する配位と周期律表第IV族の遷移化合物 を含む少なくとも1種の触媒の存在下でエチレンまたは エチレンと炭素数3~20のα-オレフィンとを(共) 重合させることにより得られる

- (a 1) 密度がO. 86~O. 96g/cm³、
- (a2) メルトフローレート0. 1~100g/10 分.
- (a3) 分子量分布 (Mw/Mn) が1.5~5.0、 (a4)組成分布パラメーターCbが1.01~1.

(a5)連続昇温溶出分別法 (TREF)による溶出温 度-溶出量曲線のピークが実質的に1個存在することを 満足するエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレ フィン共重合体 (A1) であることを特徴とする請求項 1に記載の積層体。

【請求項3】 前記の(A) エチレン単独重合体または エチレン・ α ーオレフィン共重合体が、

(a1)密度が0.86 ~0.96g/cm³、

(a2) メルトフローレート0. 1~100g/10 分、

- (a3) 分子量分布 (Mw/Mn) が1.5~5.0、
- (a4)組成分布パラメーターCbが1.08~2.0

(a5)連続昇温溶出分別法(TREF)による溶出温 度一溶出量曲線のピークが実質的に複数個存在するこ

(a6) 25℃におけるオルソジクロロベンゼン(OD CB) 可溶分量X(wt%)と密度dおよびMFR(メル

トフローレート)が次の関係を満足すること、 a) d-0.008logMFR≥0.93の場合 X < 2. 0

b) d-0.008logMFR<0.93の場合 $X < 9.8 \times 10^3 \times (0.9300 - d + 0.008 logMFR)$ 2+2.0を満足するエチレン単独重合体またはエチレン ・αーオレフィン共重合体(A2)であることを特徴と する請求項1に記載の積層体。

【請求項4】 前記(B)他のエチレン系重合体が、高 圧ラジカル重合によるエチレン(共) 重合体および/ま たは密度が $0.86\sim0.97 \text{ g/cm}^3$ のエチレンー α ーオレフイン共重合体であることを特徴とする請求項1 ~3のいずれかに記載の積層体。

【請求項5】 前記(B)他のエチレン系重合体が、高 圧ラジカル重合による低密度ポリエチレンおよび/また は密度がO.86~O.94g/cm3のエチレン-α-オレフイン共重合体であることを特徴とする請求項4記 載の積層体。

【請求項6】 前配(A)成分と(B)成分を含む組成 物が、(c1)メルトフローレート1~50g/10 分、(c2) 190℃におけるダイスウエル比(DS R) が1. 10~3. 00、(c3) 190℃における 溶融張力 (MT) が0.5~4.0gの範囲であること を特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の積層体。 【請求項7】 前記積層体の基材層からなる第1層が、 紙、セロファン、織布、不織布、ナイロン系基材、ポリ エチレンテレフタレート系基材、ポリプロピレン系基 材、合成樹脂フイルム系基材の中から選択された1種で あり、

バリヤー性材料からなる第11層が、金属箔またはエチレ ン一酢酸ビニル共重合体ケン化物であることを特徴とす る請求項1~6のいずれかに記載の積層体。

【請求項8】 前記積層体の第111層が、押出ラミネー ト成形で成形されたものであることを特徴とする請求項 1~7のいずれかに記載の積層体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[0002]

【発明の属する技術分野】本発明は、透明性、衝撃強 度、低温ヒートシール性、ヒートシール強度等のヒート シール特性等が優れ、ガスバリア一性や強い腰を有し、 突刺強度等に優れるシーラント層を有する積層体に関 し、特に低温ヒートシール性、ヒートシール強度夾雑物 ヒートシール性等のヒートシール特性、ホットタック性 や突刺強度等に優れた積層体であり、押出ラミネート成 形時におけるネックイン、ドーダウン (延展性)等の成 形性に優れた積層体であって、該積層体は、例えば潰 物、乳製品、レトルト食品あるいは冷凍食品、調味料、 菓子などの食品あるいは衣類などの各種包装材、各種液 体輸送用包材、包装袋等に好適に用いられる。

【従来の技術】食品包装材、食品包装袋等に使用される 昨今の積層体においては、柔軟性、耐突刺強度や高速製 袋時の高いヒートシール強度や低温ヒートシール性、夾 雑物ヒートシール性等のヒートシール特性、高いガスパ リヤー性、水蒸気パリヤー性等の性能が要求されてい る。このような要求から従来においては高いバリヤー性 を付与するためにアルミニウム箔やエチレン一酢酸ビニ ル共重合体ケン化物(EVOH)フイルムがパリヤー層・ として用いられ、ヒートシール層としては高圧重合法に よる低密度ポリエチレン(以下LDPEと称す)、チー グラー系触媒による重合で得られる直鎖状低密度ポリエ チレン(以下LLDPEと称す)、あるいはこれらの混 合物等が一般的に用いられている。しかし、LDPE は、成形加工性に優れるものの、低温ヒートシール性、ヒ ートシール強度、夾雑物ヒートシール性等のヒートシー ル特性、ホットタック性等が劣るという問題を有してい る,このLDPEの低温ヒートシールを改良する樹脂と してエチレン一酢酸ビニル共重合体(EVA)などが用 いられているが、このEVAにおいても前述のヒートシ 一ル強度、ホットタック性等は改良されなく、かつ高温 で成形されるラミネート加工時に臭いが発生するという 問題を有している。一方、LLDPEはヒートシール強 度、機械的強度などが優れるものの、低温ヒートシール 性、夾雑物ヒートシール性、ホットタック性等の諸物性 が劣り、成形加工性も問題となっている。 また、LL DPEの成形性を改良するためにLDPEを配合するこ とが提案されているが、LDPEを配合するため機械的 強度の低下を招くものとなり改良が求められている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記の事情に鑑み、衝撃強度、突刺強度、低温ヒートシール性、ヒートシール強度、夾雑物ヒートシール性等のヒートシール特性、ホットタック性等が良好であり、また、成形時のネックイン、ドローダウン(延展性)等の成形性などに優れた積層体を提供することを目的とするものである。【0004】

【課題を解決するための手段】本発明者は鋭意検討の結果、特定の触媒を用いたエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体と従来のエチレン系重合体とを特定量配合することにより本発明の目的を達成することを見いだし、本発明を完成するに至った。

【0005】本発明の第1は、基材層からなる第1層とパリヤー性材料層からなる第11層およびシーラント層からなる第11層で少なくとも構成される積層体であって、該シーラント層が下記エチレン系樹脂組成物からなることを特徴とする積層体である。

[エチレン系樹脂組成物]

(A) 少なくともシクロペンタジェン化合物、周期律表第IV族の遷移金属化合物を含む触媒の存在下にエチレンまたはエチレンと炭素数3~20のα-オレフィンとを

- (共) 重合させることにより得られる
- (a1)密度が0.86~0.96g/cm3、
- (a2) メルトフローレート0. 1~100g/10分.
- (a3) 分子量分布 (Mw/Mn) が1.5~5.0、
- (a4)組成分布パラメーターCbが2.00以下の要件を満足するエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体98~20重量%と、
- (B)他のエチレン系重合体2~80重量%を含む樹脂組成物である。

【0006】本発明の第2は前記請求項1に係る発明において、その(A)エチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体を、シクロペンタジエニル骨格を有する配位と周期律表第IV族の遷移化合物を含む少なくとも1種の触媒の存在下でエチレンまたはエチレンと炭素数3~20のαーオレフィンとを(共) 重合させることにより得られる

- (a1)密度がO.86~O.96g/cm³、
- (a2) メルトフローレート0. 1~100g/10 分、
- (a3)分子量分布(Mw/Mn)が1.5~5.0、
- (a4)組成分布パラメーターCbが1.01~1.

(a5) 連続昇温溶出分別法 (TREF) による溶出温度 - 溶出量曲線のピークが実質的に1個存在することを満足するエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体 (A1) にした積層体である。

【0007】本発明の第3は前記請求項1に係る発明に おいて、その(A)エチレン単独重合体またはエチレン ・αーオレフィン共重合体を、

- (a1)密度がO.86~O.96g/cm3、
- (a2) メルトフローレート0. 1~100g/10分、
- (a3)分子量分布(Mw/Mn)が1.5~5.0、
- (a4)組成分布パラメーターCbが1.08~2.0 0、
- (a5)連続昇温溶出分別法(TREF)による溶出温度一溶出量曲線のピークが実質的に複数個存在すること
- (a6) 25℃におけるオルソジクロロベンゼン (OD CB) 可溶分量X (wt%) と 密度 d 及びMFR (メルト フローレート) が次の関係を満足すること、
- a) d − 0.008 logM F R ≥ 0.93の場合 X < 2.0
- b) d-0.008logMFR<0.93の場合 X<9.8×10³×(0.9300-d+0.008logMFR) ²+2.0を満足するエチレン単独重合体またはエチレン ・αーオレフィン共重合体(A2)にした積層体であ ス

【OOO8】本発明の前記(B)他のエチレン系重合体

として、高圧ラジカル重合によるエチレン(共)重合体および/または密度が 0.86~0.97 g/cm³のエチレンー α ーオレフイン共重合体を使用することが望ましく、特に前記(B)他のエチレン系重合体が、高圧ラジカル重合による低密度ポリエチレンおよび/または密度が 0.86~0.94 g/cm³のエチレンー α ーオレフイン共重合体を用いることが好ましい。

また、第川層のエチレン系樹脂組成物は、(c 1)メルトフローレート1~50g/10分、(c 2)190℃におけるダイスウエル比(DSR)が1.10~3.00、(c 3)190℃における溶融張力(MT)が0.5~4.0gの範囲のものであることが望ましい。さらに、シーラント層を形成する第川層は、押出ラミネート成形で成形されたものであることが望ましい。【0009】

【発明の実施の形態】以下本発明を詳細に説明する。ま ず、本発明の積層体の特徴である第111層のシーラント 層について詳述する。本発明のエチレン単独重合体また はエチレン・ α ーオレフィン共重合体 (A) は、少なく ともシクロペンタジエン化合物、周期律表第IV族の遷移 化合物を含む少なくとも 1種の触媒の存在下にエチレン と炭素数3~20のαーオレフィンとの共重合させるこ とにより得られる下記 (a1) ~ (a4) の要件、 (a 1)密度が0.86~0.96g/cm3、(a2)メル トフローレートO. 1~100g/10分、(a3)分 子量分布 (Mw/Mn) が1.5~5.0、(a4) 組 成分布パラメーターCbが2. 00以下を満足するエチ レン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合 体であって、図1に示されるような、連続昇温溶出分別 法(TREF)により求めた溶出温度ー溶出量曲線にお いて実質的にピークを1個有し、シクロペンタジェニル 骨格を有する配位子と周期律表第IV族の遷移金属化合物 を含む少なくとも1種の触媒下の存在下で得られる一般 的なメタロセン触媒によるエチレン単独重合体またはエ チレン・ α -オレフィン共重合体 (A1) および/また は図2に示されるような、連続昇温溶出分別法 (TRE F)により求めた溶出温度-溶出量曲線において実質的 にピークが複数個の特殊な新規エチレン単独重合体また はエチレン・ α - オレフィン共重合体 (A2) を包含す るものである。

【0010】上記本発明のエチレン単独重合体またはエチレン・ α ーオレフィン共重合体(A)の α ーオレフィン共立合体(A)の α ーオレフィンとは、炭素数が3~20、好ましくは3~12のものであり、具体的にはプロピレン、1ーブテン、1ーペンテン、4ーメチルー1ーペンテン、1ーヘキセン、1ーオクテン、1ーデセン、1ードデセンなどが挙げられる。また、これらの α ーオレフィンの含有量は、合計で通常30モル%以下、好ましくは20モル%以下の範囲で選択されることが望ましい。

【〇〇11】また、本発明のエチレン単独重合体または

エチレン・ α ーオレフィン共重合体(A)の(a 1)密度は0.86~0.96g/cm³、好ましくは0.90~0.945g/cm³、さらに好ましくは0.91~0.935g/cm³の範囲であり、(a 2)メルトフロレート(以下MFRと称す)は0.1~100g/分、好ましくは0.5~50g/分、さらに好ましくは1.0~30g/10分の範囲である。密度が0.86g/cm³未満のものは柔らかすぎて耐熱性が不良となり、抗ブロッキング性が劣るものとなる。また0.96g/cm³を超えると硬すぎて、引き裂き強度、衝撃落下強度等が低くなる。MFRが0.1g/10分未満では成形加工性(ドローダウン性、ネックイン等)が不良となる。また、100g/10分を超えると機械的強度等が弱いものとなる。

【〇〇12】一般にエチレン単独重合体またはエチレン ・αーオレフィン共重合体の分子量分布 (Mw/Mn) は、ゲルパーミエイションクロマトグラフィー (GP C)により重量平均分子量(Mw)と数平均分子量(M n)を求め、それらの比(Mw/Mn)を算出すること により求めることができ、本発明のエチレン単独重合体 **またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A)の(a** 3) Mw/Mnは、1.5~5.0の範囲である。ま た、図1に示される一般的なメタロセン触媒によるエチ レン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合 体(A1)においては、好ましくは1.5~4.5、さ らに好ましくは1.8~3.5の範囲にあることが望ま しい。さらに、図2に示される特殊なエチレン単独重合 体またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A2)に おいては、好ましくは1.5~4.5、さらに好ましく は1.8~4.0、より好ましくは2.0~3.5の範 囲にあることが望ましい。 上記Mw/Mnが1.5未 満では成形加工性が劣り、5、0を越えるものは耐衝撃 性等の機械的強度が劣る。

【0013】本発明のエチレン単独重合体またはエチレ ン・α-オレフィン共重合体 (A) の (a 4) 組成分布 パラメーター(Cb)の測定法は下記の通りである。す なわち、酸化防止剤を加えたオルソジクロルベンゼン (ODCB) に試料を濃度がO. 2重量%となるように 135℃で加熱溶解した後、けい藻土(セライト54 5)を充填したカラムに移送した後、O. 1℃/minの 冷却速度で25℃まで冷却し、共重合体試料をセライト 表面に沈着する。次に、この試料が沈着されているカラ ムにODCBを一定流量で流しながら、カラム温度を5 ℃きざみに120℃まで段階的に昇温して行く。すると 各温度に対応した溶出成分を含んだ溶液が採取される。 この溶液にメタノールを加え、試料を沈澱後、ろ過、乾 燥し、各温度における溶出試料を得る。各試料の、重量 分率および分岐度(炭素数1000個あたりの分岐数) を測定する。分岐度は13C-NMRで測定し求める。 【0014】このような方法で30℃から90℃で採取

した各フラクションについては次のような、分岐度の補正を行う。すなわち、溶出温度に対して測定した分岐度をプロットし、相関関係を最小自乗法で直線に近似し、検量線を作成する。この近似の相関係数は十分大きい。この検量線により求めた値を各フラクションの分岐度とする。なお、溶出温度95℃以上で採取したフラクションについては溶出温度と分岐度に必ずしも直線関係が成立しないのでこの補正は行わない。

【0015】次にそれぞれのフラクションの重量分率wiを、溶出温度5[©]当たりの分岐度biの変化量(biーbi-1)で割って相対濃度ciを求め、分岐度に対して相対濃度をプロットし、組成分布曲線を得る。この組成分布曲線を一定の幅で分割し、次式より組成分布パラメーターCbを算出する。

[0016] Cb= $(\Sigma cj \cdot bj^2 / \Sigma cj \cdot bj) \div (\Sigma cj \cdot bj / \Sigma cj)$

【0017】ここで、cjとbjはそれぞれ;番目の区分の相対濃度と分岐度である。組成分布パラメーターCbは試料の組成が均一である場合に1.0となり、組成分布が広がるに従って値が大きくなる。

【0018】本発明のエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A)の(a4)組成分布パラメーター(Cb)は2.00以下であり、一般的なメタロセン触媒によるエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A1)においては、好ましくは1.01~1.2、さらに好ましくは1.02~1.18、より好ましくは1.03~1.16の範囲にあることが望ましい。また、本発明の特殊なエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A2)においては、好ましくは1.08~2.00、さらに好ましくは1.10~1.80、より好ましくは1.15~1.50の範囲にあることが望ましい。組成分布パラメーター(Cb)が2.00より大きいとブロッキングしやすく、また低分子量あるいは高分岐度成分の樹脂表面へのにじみ出しが多く衛生上の問題が生じる。

【0019】本発明の特殊なエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A2)は、(a5)連続昇温溶出分別法(TREF)により求めた溶出温度一溶出量曲線において、ピークが複数個存在し、図1の一般的なメタロセン触媒による重合体(A1)と明確に区別されるものである。この複数のピーク温度は85℃から100℃の間に存在することが特に好ましい。このピークが存在することにより、成形体の耐熱性が向上する。

【0020】本発明に係わるTREFの測定方法は下記の通りである。試料を酸化防止剤(例えば、ブチルヒドロキシトルエン)を加えたODCBに試料濃度が0.05重量%となるように加え、135℃で加熱溶解する。この試料溶液5mlを、ガラスピーズを充填したカラムに注入し、0.1℃/分の冷却速度で25℃まで冷却し、

試料をガラスピーズ表面に沈着する。次に、このカラムにODCBを一定流量で流しながら、カラム温度を50℃/hrの一定速度で昇温しながら、試料を順次溶出させる。この際、溶剤中に溶出する試料の濃度は、メチレンの非対称伸縮振動の波数2925cm⁻¹に対する吸収を赤外検出機で測定することにより連続的に検出される。この値から、溶液中のエチレン・αーオレフィン共重合体の濃度を定量分析し、溶出温度と溶出速度の関係を求める。TREF分析によれば、極少量の試料で、温度変化に対する溶出速度の変化を連続的に分析出来るため、分別法では検出できない比較的細かいピークの検出が可能である。

【0021】本発明の特殊なエチレン単独重合体またはエチレン・ α ーオレフィン共重合体(A2)の(a6)25℃におけるODCB可溶分の量 X(重量%)と密度はおよびMFRの関係は、dおよびMFRの値が、dー0.008logMFR \geq 0.93を満たす場合は、Xは2重量%未満、好ましくは1重量%未満、d-0.008logMFR<0.93の場合は、

 $X < 9.8 \times 10^3 \times (0.9300 - d + 0.008 logMFR)^2 + 2.0$

好ましくは、

 $X < 7.4 \times 10^3 \times (0.9300 - d + 0.008 logMFR)^2 + 1.0$

さらに好ましくは、

 $X < 5.6 \times 10^3 \times (0.9300 - d + 0.008 \log M F R)^2 + 0.5$

の関係を満足していることが必要である。

【0022】上記25℃におけるODCB可溶分の量は、下記の方法により測定する。試料0.5gを20mlのODCBにて135℃で2時間加熱し、試料を完全に溶解した後、25℃まで冷却する。この溶液を25℃で一晩放置後、テフロン製フィルターで濾過して濾液を採取する。この濾液のメチレンの非対称伸縮振動の波数2925cm⁻¹付近の吸収ピーク面積を求め、予め作成した検量線により試料濃度を算出する。この値より25℃におけるODCB可溶分量が求まる。

【0023】25℃におけるODCB可溶分は、エチレン・αーオレフィン共重合体に含まれる高分岐度成分および低分子量成分であり、衛生性の問題や成形品内面のブロッキングの原因となる為、この含有量は少ないことが望ましい。ODCB可溶分の量は、コモノマーの含有量および分子量に影響される。従ってこれらの指標である密度およびMFRとODCB可溶分の量が上記の関係を満たすことは、共重合体全体に含まれるαーオレフィンの偏在が少ないことを示す。

【0024】前配一般的なメタロセン触媒による、エチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A1)はシクロペンタジエニル骨格を有する配位子を含む周期律表第IV族の遷移金属化合物と必要により助

触媒、有機アルミニウム化合物、担体とを含む触媒の存在下にエチレンおよび炭素数3~20のαーオレフィンとを共重合させることにより得られるものである。

【0025】このエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A1)を製造する触媒であるシクロペンタジエニル骨格を有する配位子を含む周期律表第IV族の遷移金属化合物のシクロペンタジエニル骨格とは、シクロペンタジエニル基、置換シクロペンタジエニル基等である。置換シクロペンタジエニル基としては、炭素数1~10の炭化水素基、シリル基、シリル置換アルキル基、シリル置換アリール基、シアノ基、シアノアルキル基、シアノアリール基、ハロゲン基、ハロアルキル基、ハロシリル基等から選ばれた少なくとも1種の置換基を有する置換シクロペンタジエニル基等である。該置換シクロペンタジエニル基の置換基は2個以上有していてもよく、また係る置換基同士が互いに結合して環を形成してもよい。

【0026】上記炭素数1~10の炭化水素基として は、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アラ ルキル基等が挙げられ、具体的には、メチル基、エチル 基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、 イソブチル基、secーブチル基、tーブチル基、ペン チル基、ヘキシル基、オクチル基、2-エチルヘキシル 基、デシル基等のアルキル基:シクロペンチル基、シク ロアルキル基等のシクロアルキル基;フェニル基、トリ ル基等のアリール基:ペンジル基、ネオフイル基等のア ラルキル基等が例示される。これらの中でもアルキル基 が好ましい。 置換シクロペンタジエニル基の好適なも のとしては、メチルシクロペンタジエニル基、エチルシ クロペンタジエニル基、n-ヘキシルシクロペンタジェ ニル基、1,3-ジメチルシクロペンタジエニル基、1,3-n-ブチルメチルシクロペンタジエニル基、1,3-n-プロピル メチルエチルシクロペンタジエニル基などが具体的に挙 げられる。本発明の置換シクロペンタジエニル基として は、これらの中でも炭素数3以上のアルキル基が置換し たシクロペンタジエニル基が好ましく、特に1,3-置換シ クロペンタジエニル基が好ましい。置換基同士すなわち 炭化水素同士が互いに結合して1または2以上の環を形 成する場合の置換シクロペンタジエニル基としては、イ ンデニル基、炭素数1~8の炭化水素基(アルキル基 等) 等の置換基により置換された置換インデニル基、ナ フチル基、炭素数1~8の炭化水素基(アルキル基等) 等の置換基により置換された置換ナフチル基、炭素数1 ~8の炭化水素基(アルキル基等)等の置換基により置 換された置換フルオレニル基等が好適なものとして挙げ

【0027】シクロペンタジエニル骨格を有する配位子を含む周期律表第IV族の遷移金属化合物の遷移金属としては、ジルコニウム、チタン、ハフニウム等が挙げられ、特にジルコニウムが好ましい。該遷移金属化合物

は、シクロペンタジエニル骨格を有する配位子としては 通常1~3個を有し、また2個以上有する場合は架橋基 により互いに結合していてもよい。なお、係る架橋基と しては炭素数1~4のアルキレン基、アルキルシランジ イル基、シランジイル基などが挙げられる。

【0028】周期律表第IV族の遷移金属化合物においてシクロペンタジエニル骨格を有する配位子以外の配位子としては、代表的なものとして、水素、炭素数1~20の炭化水素基(アルキル基、アルケニル基、アリール基、アルキルアリール基、アラルキル基、ポリエニル基等)、ハロゲン、メタアルキル基、メタアリール基などが挙げられる。

【0029】これらの具体例としては以下のものがあ る。ジアルキルメタロセンとして、ピス(シクロペンタ ジエニル) チタニウムジメチル、 ビス (シクロペンタ ジエニル) チタニウムジフェニル、ピス (シクロペンタ ジエニル) ジルコニウムジメチル、ビス(シクロペンタ ジエニル) ジルコニウムジフェニル、ビス (シクロペン タジエニル) ハフニウムジメチル、 ビス (シクロペン タジエニル)ハフニウムジフェニルなどがある。モノア ルキルメタロセンとしては、ビス (シクロペンタジエニ ル)チタニウムメチルクロライド、ピス(シクロペンタ ジエニル) チタニウムフェニルクロライド、ビス (シク ロペンタジエニル)ジルコニウムメチルクロライド、ビ ス(シクロペンタジエニル)ジルコニウムフェニルクロ ライドなどがある。また、モノシクロペンタジエニルチ タノセンであるペンタメチルシクロペンタジエニルチタ ニウムトリクロライド、ペンタエチルシクロペンタジェ ニルチタニウムトリクロライド)、ビス(ペンタメチル シクロペンタジエニル)チタニウムジフェニルなどが挙 げられる。

【0030】置換ビス(シクロペンタジエニル) チタニウム化合物としては、ビス(インデニル) チタニウムジフェニルまたはジクロライド、ビス(メチルシクロペンタジエニル) チタニウムジフェニルまたはジクロライド、ジアルキル、トリアルキル、テトラアルキルまたはペンタアルキルシクロペンタジエニルチタニウム化合物としては、ビス(1,2ージメチルシクロペンタジエニル) チタニウムジフェニルまたはジクロライド、ビス(1,2ージエチルシクロペンタジエニル) チタニウムジフェニルまたはジクロライドまたは他のジハライド錯体、シリコン、アミンまたは炭素連結シクロペンタジエニルチタニウムジフェニルまたはジクロライド、メチレンジシクロペンタジエニルチタニウムジフェニルまたはジクロライド、他のジハライド錯体が挙げられる。

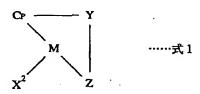
【0031】ジルコノセン化合物としては、ペンタメチルシクロペンタジエニルジルコニウムトリクロライド、ペンタエチルシクロペンタジエニルジルコニウムトリクロライド、ピス (ペンタメチルシクロペンタジエニル)

ジルコニウムジフェニル、アルキル置換シクロペンタジ エンとしては、ビス(エチルシクロペンタジエニル)ジ ルコニウムジメチル、ビス(メチルシクロペンタジエニ ル)ジルコニウムジメチル、ピス(nーブチルシクロペ ンタジエニル)ジルコニウムジメチル、それらのハロア ルキルまたはジハライド錯体、ジアルキル、トリアルキ ル、テトラアルキルまたはペンタアルキルシクロペンタ ジェンとしてはビス(ペンタメチルシクロペンタジェニ ル) ジルコニウムジメチル、ビス (1,2ージメチルシ クロペンタジエニル) ジルコニウムジメチル、およびそ れらのジハライド錯体、シリコン、炭素連結シクロペン タジエン錯体としては、ジメチルシリルジシクロペンタ ジェニルジルコニウムジメチルまたはジハライド、メチ レンジシクロペンタジエニルジルコニウムジメチルまた はジハライド、メチレンジシクロペンタジエニルジルコ ニウムジメチルまたはジハライドなどが挙げられる。

【0032】さらに他のメタロセンとしては、ビス(シクロペンタジエニル)ハフニウムジクロライド、ビス(シクロペンタジエニル)ハフニウムジメチル、ビス(シクロペンタジエニル)パナジウムジクロライドなどが挙げられる。

【0033】本発明の他の周期律表第IV族の遷移金属化合物の例として、下記一般式で示されるシクロペンタジエニル骨格を有する配位子とそれ以外の配位子および遷移金属原子が環を形成するものも挙げられる。

【化1】



式中、Cpは前記シクロペンタジエニル骨格を有する配位子、Xは水素、ハロゲン、炭素数1~20のアルキル基、アリールシリル基、アリールオキシ基、アルコキシ基、アミド基、シリルオキシ基等を表し、YはSiR2、CR2、SiR2SiR2、CR2CR2、CR=CR、SiR2CR2、BRからなる群から選ばれる2価基、Zは一〇一、一S一、一NR一、一PR一またはOR、SR、NR2、PR2からなる群から選ばれる2価中性リガンドを示す。ただし、Rは水素または炭スケン化アルキル基、アリール基、シリル基、ハロゲン化アルキル基、ハロゲン化アリール基、またはY、ZまたはYとZの双方からの2個またはそれ以上のR基は縮合環系を形成するものである。Mは周期律表第IV族の遷移金属原子を表す。

【0034】式1で表される化合物の例としては、(tーブチルアミド)(テトラメチルシクロペンタジエニ

ル) -1,2-エタンジイルジルコニウムジクロライ ド、(tープチルアミド)(テトラメチルシクロペンタ ジエニル) -1,2-エタンジイルチタンジクロライ ド、(メチルアミド)(テトラメチルシクロペンタジェ ニル) -1,2-エタンジイルジルコニウムジクロライ ド、(メチルアミド)(テトラメチルシクロペンタジエ ニル) -1,2-エタンジイルチタンジクロライド、 (エチルアミド) (テトラメチルシクロペンタジエニ ル) メチレンタンジクロライド、 (tーブチルアミド) ジメチル (テトラメチルシクロペンタジエニル) シラン チタンジクロライド、(tーブチルアミド) ジメチル (テトラメチルシクロペンタジエニル) シランジルコニ ウムジベンジル、 (ベンジルアミド) ジメチル (テトラ メチルシクロペンタジエニル) シランチタンジクロライ ド、(フェニルホスフイド)ジメチル(テトラメチルシ クロペンタジエニル)シランチタンジクロライドなどが 挙げられる。

【0035】本発明でいう助触媒としては、前記周期律表第IV族の遷移金属化合物を重合触媒として有効になしうる、または触媒的に活性化された状態のイオン性電荷を均衡させうるものをいう。本発明において用いられる助触媒としては、有機アルミニウムオキシ化合物のベンゼン可溶のアルミノキサンやベンゼン不溶の有機アルミニウムオキシ化合物、ホウ素化合物、酸化ランタンなどのランタノイド塩、酸化スズ等が挙げられる。これらの中でもアルミノキサンが最も好ましい。

【0036】また、触媒は無機又は有機化合物の担体に担持して使用されてもよい。該担体としては無機または有機化合物の多孔質酸化物が好ましく、具体的にはSiO2、Al2O3、MgO、ZrO2、TiO2、B2O3、CaO、ZnO、BaO、ThO2等またはこれらの混合物が挙げられ、SiO2-Al2O3、SiO2-V2O5、SiO2-TiO2、SiO2-MgO、SiO2-Cr2O3等が挙げられる。

【0037】有機アルミニウム化合物として、トリエチルアルミニウム、トリイソプロピルアルミニウム等のトリアルキルアルミニウム;ジアルキルアルミニウムハライド;アルキルアルミニウムシハライド;アルキルアルミニウムジハライド;アルキルアルミニウムバイドライド、有機アルミニウムアルコキサイド等が挙げられる。

【0038】本発明の特殊なエチレン単独重合体またはエチレン・ α ーオレフィン共重合体(A2)の製造は、好ましくは以下のD1~D5の触媒で重合することが望ましい。

D1:一般式 $Me^1R^1_p$ (OR^2) $_qX^1_{4-p-q}$ で表される 化合物 (式中 Me^1 はジルコニウム、チタン、ハフニウムを示し、R1および R^2 はそれぞれ炭素数 $1\sim 2$ 4の炭化水素基、 X^1 はハロゲン原子を示し、pおよびqはそれぞれ $0\leq p<4$ 、 $0\leq p+q\leq 4$ の範囲を満たすを整

数である)。

D2: -般式Me 2 R3m (OR4) $_{\rm I}$ X 2 Z- $_{\rm III}$ rm・で表される化合物 (式中Me 2 は周期律表第 $_{\rm I}$ ~ $_{\rm III}$ 族元素、R 3 およびR 4 はそれぞれ炭素数 $_{\rm I}$ ~ $_{\rm III}$ を次素基、X 2 はハロゲン原子または水素原子 (ただし、X 2 が水素原子の場合はMe 2 は周期律表第 $_{\rm III}$ 族元素の場合に限る)を示し、zはMe 2 の価数を示し、mおよび nはそれぞれ 0 \leq m \leq z の範囲を満たす整数であり、かつ、0 \leq m + n \leq z である)。

D3:共役二重結合を持つ有機環状化合物。

D4: AI-O-AI結合を含む変性有機アルミニウム オキシ化合物。

D5:無機担体および/又は粒子状ポリマー担体を相互に接触させて得られる触媒。

【0039】以下、さらに詳説する。上記触媒成分D1 の一般式 $M e^{1}R^{1}p$ (OR²) $qX^{1}4-p-q$ で表される化合 物の式中、Me¹はジルコニウム、チタン、ハフニウム を示し、これらの遷移金属の種類は限定されるものでは なく、複数を用いることもできるが、共重合体の耐候性 の優れるジルコニウムが含まれることが特に好ましい。 R¹およびR²はそれぞれ炭素数1~24の炭化水素基 で、好ましくは炭素数1~12、さらに好ましくは1~ 8である。具体的にはメチル基、エチル基、プロピル 基、イソプロピル基、ブチル基などのアルキル基;ビニ ル基、アリル基などのアルケニル基;フェニル基、トリ ル基、キシリル基、メシチル基、インデニル基、ナフチ ル基などのアリール基:ベンジル基、トリチル基、フェ ネチル基、スチリル基、ベンズヒドリル基、フェニルブ チル基、ネオフイル基などのアラルキル基などが挙げら れる。これらは分岐があってもよい。X¹はフッ素、ヨ ウ素、塩素および臭素などのハロゲン原子を示す。pお よびqはそれぞれ、O≦p<4、O≦p+q≦4の範囲 を満たすを整数である。

【OO4O】上記触媒成分D1の一般式で示される化合 物の例としては、テトラメチルジルコニウム、テトラエ チルジルコニウム、テトラベンジルジルコニウム、テト ラプロポキシジルコニウム、トリプロポキシモノクロロ ジルコニウム、テトラブトキシジルコニウム、テトラブ トキシチタン、テトラブトキシハフニウムなどが挙げら れ、特にテトラプロポキシジルコニウム、テトラブトキ シジルコニウムなどのZr (OR) 4化合物が好まし く、これらを2種以上混合して用いても差し支えない。 【0041】上記触媒成分D2の一般式Me²R³m(O R^4) $_{\rm N} \times ^2 Z^{-m-n}$ で表される化合物の式中M $_{\rm P}$ 2は周期律 表第1~111族元素を示し、リチウム、ナトリウム、カ リウム、マグネシウム、カルシウム、亜鉛、ホウ素、ア ルミニウムなどである。R3およびR4はそれぞれ炭素 数1~24の炭化水素基、好ましくは炭素数1~12、 さらに 好ましくは1~8であり、具体的にはメチル 基、エチル基、プロビル基、イソプロビル基、ブチル基 などのアルキル基: ビニル基、アリル基などのアルケニル基: フェニル基、トリル基、キシリル基、メシチル基、インデニル基、ナフチル基などのアリール基: ベンジル基、トリチル基、フェネチル基、スチリル基、ベンズヒドリル基、フェニルブチル基、ネオフイル基などのアラルキル基などが挙げられる。これらは分岐があってもよい。 \mathbf{X}^2 はフッ素、ヨウ素、塩素および臭素などのハロゲン原子または水素原子を示すものである。ただし、 \mathbf{X}^2 が水素原子の場合は \mathbf{M} \mathbf{e} $\mathbf{2}$ はホウ素、アルミニウムなどに例示される周期律表第 $\mathbf{11}$ 族元素の場合に限るものである。また、 \mathbf{z} は \mathbf{M} \mathbf{e} $\mathbf{2}$ の価数を示し、mおよびnはそれぞれ、 $\mathbf{0} \leq \mathbf{m} \leq \mathbf{z}$ の範囲を満たす整数であり、かつ、 $\mathbf{0} \leq \mathbf{m} + \mathbf{n} \leq \mathbf{z}$ である。

【0042】上記触媒成分D2の一般式で示される化合物の例としては、メチルリチウム、エチルリチウムはでがあった。ジェチルマグネシウムと合物:ジメチルマグネシウムクロライド、エチルマグネシウムクロライドなどの有機では、シェーの出版では、カリエチルでは、トリエチルでは、トリエチルでは、トリエチルでは、トリエチルでは、トリエチルでは、トリエチルでは、トリエチルでは、カリスチルでは、カリスチルでは、カリスチルでは、カリスチルでは、カリスチルでは、カリスチルでは、カリスチルでルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、シェチルアルミニウム、トリデシルアルミニウムがクロライド、エチルアルミニウムでは、ジェチルアルミニウムエトキサイド、ジェチルアルミニウムバードなどの有機アルミニウム化合物等の誘導体が挙げられる。

【0043】上記触媒成分D3の共役二重結合を持つ有 機環状化合物には、環状で共役二重結合を2個以上、好 ましくは2~4個、さらに好ましくは2~3個有する環 を1個または2個以上もち、全炭素数が4~24、好ま しくは4~12である環状炭化水素化合物;前記環状炭 化水素化合物が部分的に1~6個の炭化水素残基(典型 的には、炭素数1~12のアルキル基またはアラルキル 基)で置換された環状炭化水素化合物;共役二重結合を 2個以上、好ましくは2~4個、さらに好ましくは2~ 3個有する環を1個または2個以上もち、全炭素数が4 ~24、好ましくは4~12である環状炭化水素基を有 する有機ケイ素化合物;前配環状炭化水素基が部分的に 1~6個の炭化水素残基またはアルカリ金属塩(ナトリ ウムまたはリチウム塩)で置換された有機ケイ素化合物 が含まれる。特に好ましくは分子中のいずれかにシクロ ペンタジエン構造をもつものが望ましい。

【0044】上記の好適な化合物としては、シクロペンタジエン、インデン、アズレンまたはこれらのアルキル、アリール、アラルキル、アルコキシまたはアリールオキシ誘導体などが挙げられる。また、これらの化合物がアルキレン基(その炭素数は通常2~8、好ましくは2~3)を介して結合(架橋)した化合物も好適に用い

られる。

【0045】環状炭化水素基を有する有機ケイ素化合物は、下配一般式で表示することができる。

ALS I R4-L

【0046】上記成分D3の有機環状炭化水素化合物の 具体例として、シクロペンタジエン、メチルシクロペン タジエン、エチルシクロペンタジエン、1、3ージメチ ルシクロペンタジエン、インデン、4ーメチルー1ーイ ンデン、4、7ージメチルインデン、シクロヘプタトリ エン、メチルシクロヘプタトリエン、シクロオクタテト ラエン、アズレン、フルオレン、メチルフルオレンのよ うな炭素数5~24のシクロポリエンまたは置換シクロ ポリエン、モノシクロペンタジエニルシラン、ビスシク ロペンタジエニルシラン、トリスシクロペンタジエニル シラン、モノインデニルシランなどが挙げられる。

【0047】触媒成分D4のA1-O-A1結合を含む変性有機アルミニウムオキシ化合物とは、アルキルアルミニウム化合物と水とを反応させることにより、通常アルミノキサンと称される変性有機アルミニウムオキシ化合物が得られ、分子中に通常1~100個、好ましくは1~50個のA1-O-A1結合を含有する。また、変性有機アルミニウムオキシ化合物は線状でも環状でもいずれでもよい。

【0048】有機アルミニウムと水との反応は通常不活性炭化水素中で行われる。該不活性炭化水素としては、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン、ベンゼン、トルエン、キシレン等の脂肪族、脂環族、芳香族炭化水素が好ましい。水と有機アルミニウム化合物との反応比(水/AIモル比)は通常 0.25 / 1 ~ 1.2 / 1、好ましくは 0.5 / 1 ~ 1 / 1 であることが望ましい。

【0049】触媒成分D5の無機物担体および/または粒子状ポリマー担体とは、炭素質物、金属、金属酸化物、金属塩化物、金属炭酸塩またはこれらの混合物あるいは熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂等が挙げられる。該無機物担体に用いることができる好適な金属としては、鉄、アルミニウム、ニッケルなどが挙げられる。具体的には、SiO2、AI2O3、MgO、ZrO2、TiO2、B2O3、CaO、ZnO、BaO、ThO2等また

はこれらの混合物が挙げられ、SiO2-Al2O3、SiO2-V2O5、SiO2-TiO2、SiO2-V2O5、SiO2-TiO2、SiO2-V2O5、SiO2-MgO、SiO2-Cr2O3等が挙げられる。これらの中でもSiO2およびAl2O3からなる群から選択された少なくとも1種の成分を主成分とするものが好ましい。また、有機化合物としては、熱可塑性樹脂、熟硬化性樹脂のいずれも使用でき、具体的には、粒子状のポリオレフィン、ポリエステル、ポリアミド、ポリ塩化ビニル、ポリ(メタ)アクリル酸メチル、ポリスチレン、ポリノルボルネン、各種天然高分子およびこれらの混合物等が挙げられる。

【0050】上記無機物担体および/または粒子状ポリマー担体は、このまま使用することもできるが、好ましくは予備処理としてこれらの担体を有機アルミニウム化合物やAI-O-AI結合を含む変性有機アルミニウムオキシ化合物などに接触処理させた後に成分D5として用いることもできる。

【0051】上記本発明のエチレン単独重合体またはエチレン・αーオレフィン共重合体(A2)は分子量分布が狭く、組成分布が適度な広さを有し、機械的強度が強く、ヒートシール性、抗ブロッキング性に優れしかも耐熱性の良い重合体である。

【0052】本発明のエチレン単独重合体またはエチレ ン・ α ーオレフィン共重合体(A)の製造方法は、前記 触媒の存在下、実質的に溶媒の存在しない気相重合法、 スラリー重合法、溶液重合法等で製造され、実質的に酸 素、水等を断った状態で、ブタン、ペンタン、ヘキサ ン、ヘプタン等の脂肪族炭化水素、ベンゼン、トルエ ン、キシレン等の芳香族炭化水素、シクロヘキサン、メ チルシクロヘキサン等の脂環族炭化水素等に例示される 不活性炭化水素溶媒の存在下または不存在下で製造され る。重合条件は特に限定されないが、重合温度は通常1 5~350℃、好ましくは20~200℃、さらに好ま しくは50~110℃であり、重合圧力は低中圧法の場 合通常常圧~7 Okg/cm²G、好ましくは常圧~2 Okg/cm 2Gであり、高圧法の場合通常1500kg/cm²G以下が望 ましい。重合時間は低中圧法の場合通常3分~10時 間、好ましくは5分~5時間程度が望ましい。高圧法の 場合、通常1分~30分、好ましくは2分~20分程度 が望ましい。また、重合は一段重合法はもちろん、水素 濃度、モノマー濃度、重合圧力、重合温度、触媒等の重 合条件が互いに異なる2段階以上の多段重合法など特に 限定されるものではない。

【0053】本発明における(B)他のエチレン系重合体とは、高圧ラジカル重合によるエチレン系重合体(B1)および/または密度が $0.86\sim0.97\,g/cm^3$ のエチレンー α ーオレフイン共重合体(B2)を包含するものである。

【0054】上記(B1)高圧ラジカル重合法によるエチレン系重合体とは、高圧ラジカル重合法による密度

0.91~0.94g/cm 3 のエチレン単独重合体(低密度ポリエチレン)、エチレン・ビニルエステル共重合体およびエチレンと α , β -不飽和カルポン酸またはその誘導体との共重合体等が挙げられる。

【0055】該(B11)低密度ポリエチレン(以下し DPEと称す)は、MFRが0.05~50g/10 分、好ましくは0.1~30g/10分の範囲で選択される。この範囲内であれば組成物の溶融張力が適切な範囲となり押出ラミネート成形等が容易である。該しDPEの密度は0.91~0.94g/cm³、好ましくは0.912~0.935g/cm³、さらに好ましくは0.912~0.930g/cm³の範囲で選択される。また、分子量分布(Mw/Mn)は3.0~12、好ましくは4.0~8.0である。これらしDPEの製法は、公知の高圧ラジカル重合法により製造され、チューブラー法、オートクレーブ法のいずれでもよい。

【0056】また、上記(B12)エチレン・ビニルエステル共重合体とは、高圧ラジカル重合法で製造され、エチレンを主成分とし、プロピオン酸ビニル、酢酸ビニル、カプリル酸ビニル、ラウリル酸ビニル、ステアリン酸ビニル、トリフルオル酢酸ビニルなどのビニルエステル単量体との共重合体である。これらの中でも特に好ましいものとしては、酢酸ビニルなどのできる。エチレン50~99.5重量%、亡ニルエステル0.5~50重量%、他の共重合体が好ることができる。エチレン50~99.5重量%にないこれエステル0.5~50重量%がらなる共重合体が好ましい。さらにビニルエステル含有量は3~20重量%、特に好ましくは5~15重量%の範囲で選択される。これら共重合体のMFRは、0.1~50g/10分、好ましくは0.3~30g/分の範囲で選択される。

【0057】さらに上記(B13)エチレンとα,β-不飽和カルボン酸またはその誘導体との共重合体の代表 的な共重合体としては、エチレン・(メタ) アクリル酸 またはそのアルキルエステル共重合体が挙げられ、これ らのコモノマーとしては、アクリル酸、メタクリル酸、 アクリル酸メチル、メタクリル酸メチル、アクリル酸エ チル、メタクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、メタ クリル酸プロピル、アクリル酸イソプロピル、メタクリ ル酸イソプロピル、アクリル酸-n-ブチル、メタクリ ル酸-n-ブチル、アクリル酸シクロヘキシル、メタク リル酸シクロヘキシル、アクリル酸ラウリル、メタクリ ル酸ラウリル、アクリル酸ステアリル、メタクリル酸ス テアリル、アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシ ジル等を挙げることができる。この中でも特に好ましい ものとして(メタ)アクリル酸のメチル、エチル等のア ルキルエステルを挙げることができる。特に(メタ)ア クリル酸エステル含有量は3~20重量%、好ましくは 5~15重量%の範囲である。これら共重合体のMFR は、0. 1~30g/10分、好ましくは0. 2~20 g/分の範囲で選択される。

【0058】本発明の他のエチレン系重合体の密度が 0.86~0.97g/cm³のエチレンー α ーオレフイン共重合体(B2)とは、従来公知のチーグラー系触媒 あるいはフィリップス系触媒等を用いる、高・中・低圧法およびその他の公知の方法によるエチレンと炭素数3~12の α ーオレフィンとの共重合体である。これは、 (A) 成分より一般的には分子量分布あるいは組成分が広く、密度が 0.94 α 0.97 α 0の高密度ポリエチレン、0.91 α 0.94 α 00の線状低密度 ポリエチレン(以下 L L D P E と称す)、密度が 0.86~0.91 α 0の超低密度ポリエチレン(以下 V L D P E と称す)、密度が 0.86~0.91 α 0のエチレン・プロピレン共重合体ゴム、エチレン・プロピレン・ジェン共重合体ゴム等のエチレン・ α 0つのエチレン・プロピレン共工会体ゴム等のエチレン・カーフィン共重合体ゴムを包含する。

【0059】本発明における高密度ポリエチレンは、密 度が0.94~0.97g/cm3、好ましくは0.95 ~0. 97g/cm³、メルトフローレートが0. 01~ 50g/10分、好ましくは0.05~30g/10 分、特に好ましくはO. 1~20g/10分である。 【0060】上記LLDPEとは、密度が0.91~ O. 94g/cm³、好ましくはO. 91~O. 93g/c m^3 の範囲のエチレン・ α ーオレフィン共重合体であり、 MFRが0.05~50g/10分、好ましくは0.1 ~30g/10分の範囲で選択される。分子量分布 (M w/Mn)は特に限定はないが、3.0~13、好まし くは3.5~8.0の範囲にあるのが一般的である。上 記LLDPEの α ーオレフィンは、炭素数3~20、好 ましくは炭素数4~12、さらに好ましくは炭素数6~ 12の範囲のαーオレフィンであり、具体的にはプロピ レン、1ーブテン、4ーメチルー1ーペンテン、1ーへ キセン、1-オクテン等が挙げられる。上記MFRが 0.05g/10分未満では、成形加工性が悪化し、5 Og/10分を超えるものは耐衝撃性やヒートシール特 性等が低下する虞を生じる。

【0061】また上記VLDPEとは、密度が0.86~0.91g/cm³、好ましくは0.88~0.905g/cm³の範囲のエチレンーαーオレフィン共重合体であり、MFRが0.01~50g/10分、好ましくしひ、好ましくは0.1~30g/10分の範囲で選択される。該VLDPEは、線状低密度ポリエチレン(LLDPE)とエチレン・αーオレフィン共重合体であり、示差走を熱量測定法(DSC)による最大ピーク温度(Tm)60℃以上、好ましくは、100℃以上、かる特定のエチレン・αーオレフィン共重合体であり、LLDPEが示す高結晶部分とエチレン・αーオレフィン共重合体であり、LLDPEが示す高結晶部分とエチレン・カーオレフィン共重合体であり、による最大ピーク温度の対象である特別である対象である耐衝撃性、耐熱性などと、後者の特徴であるゴ

ム状弾性、耐低温衝撃性などがパランスよく共存してい

【0062】また上記エチレン・ α -オレフィン共重合 体ゴムとは、密度が O. 86~ O. 91g/cm³未満の エチレン・プロピレン共重合体ゴム、エチレン・プロピ レン・ジエン共重合体ゴム等が挙げられ、該エチレン・ プロピレン系ゴムとしては、エチレン及びプロピレンを 主成分とするランダム共軍合体(EPM)、および第3 成分としてジェンモノマー(ジシクロペンタジェン、エ チリデンノルボルネン等)を加えたものを主成分とする ランダム共重合体(EPDM)が挙げられる。

【0063】上記(B)他のエチレン系重合体のなかで も、高圧ラジカル重合による低密度ポリエチレンおよび /または密度がO.86~O.94g/cm³のエチレン αーオレフイン共重合体が好ましい。

【OO64】本発明における樹脂組成物の(A)成分と (B) 成分の配合割合は、(A) 成分が98~20重量 %、(B)成分が2~80重量%、好ましくは(A)成 分が90~60重量%、(B) 成分が10~40重量 %、さらに好ましくは(A)成分が85~70重量%、

(B) 成分が15~30重量%である。該組成物の

(A) 成分の配合量が98重量%を超える場合には、ド ローダウン性、ネックイン等の成形加工性が劣るものと なり、20重量%より少ない場合には、突刺強度、低温 ヒートシール性、ヒートシール強度、夾雑物ヒートシー ル性等のヒートシール特性、ホットタック性等が改良さ れない慮がある。

【0065】上記本発明の組成物の具体的な例として は、(A1+B11)、(A2+B11)、(A1+B 11+B21) (A2+B11+B21) (A1+ B12+B21) (A2+B12+B21) (A1+ B11+B22) (A2+B11+B22) (A1+ A2+B11) (A1+A2+B11+B21) (A 1+A2+B11+B22) などの種々の組み合わせが 挙げられる(ただし、A1:本発明のエチレンー α -オ レフイン共重合体、A2:本発明の他のエチレンー α -オレフイン共重合体、B11:LDPE、B12:EV A、B21:LLDPE、B22:VLDPEを示 す)。特に(A1またはA2+B11+B21)、(A 1+B11+B22)、すなわち、本発明のエチレンー α ーオレフイン共重合体(A1またはA2)とLDP E、LLDPEの組み合わせの場合の配合量は(A)成 分60~90重量%、(B1)成分5~35重量%、 (B2) 成分5~35重量%の範囲で選択されることが

望ましい。

【0066】上記本発明の(A)成分と(B)成分を含 む組成物は、(c1)メルトフロレート(MFR)が1 ~100g/10分、(c2) 190℃におけるダイス ウエル比 (DSR) が1. 10~3. 00、(c3) 1 90°Cにおける溶融張力 (MT) がO. 5~4. Ogの 範囲であることが望ましい。上記(c1)MFRが1g /10分未満であると成形加工性が劣り、100g/1 O分を超えるものは突刺強度等の機械的強度が改良され ない虞がある。また、(c2)ダイスウエル比(DS R) が1.10未満であるとネックインが大きく、3. O O を超える場合には高速成形性に難がある。 (c3) 溶融張力(MT)がO. 5g未満であるとドローダウン 性が劣り、4.0gを超えるものは高速成形性が低下す る虞がある。

【0067】本発明の組成物においては、上記(A)成 分として、(A1)成分を用いた際には、(c1)メル トフロレート (MFR) が1~50g/10分、好まし くは1.5~40g/10分、さらに好ましくは2.0 ~30g/10分の範囲、(c2)190℃におけるダ イスウエル比(DSR)が1.30~3.00、好まし くは1、30~2.80、さらに好ましくは1.30~ 2. 50の範囲、(c3) 190℃における溶融張力 (MT) がO. 5~4. Og、好ましくはO. 5~3. 5gの範囲であることが望ましい。

【0068】本発明の組成物においては、上記(A)成 分として、(A2)成分を用いた際には、(c1)メル トフロレート (MFR) が1~50g/10分、好まし くは1.5~40g/10分、さらに好ましくは2.0 ~30g/10分の範囲、(c2) 190℃におけるダ イスウエル比 (DSR) が1. 10~2. 00、好まし くは1. 10~1. 70、さらに好ましくは1. 10~ 1. 65の範囲、(c3) 190℃における溶融張力 (MT) が0. 5~4. 0g、好ましくは0. 5~2. 5gの範囲であることが望ましい。

【0069】本発明の組成物の配合は従来の樹脂組成物 配合法として一般に用いられる公知の方法により配合す ることができる。その一例としては(A)成分、(B) 成分、およびその他の添加可能なポリオレフィン樹脂等 をフィルム成形時に単にドライブレンドすることにより 行える。また、他の例としては(A)成分、(B)成分 および所望により各種添加剤をタンブラー、リボンブレ ンダーまたはヘンシェルミキサー等の混合機を使用して ドライブレンドした後、単軸押出機、二軸押出機等の連 続式溶融混練機をにより溶融混合し、押出してペレット を調製することによって該樹脂組成物を得ることができ る。

【〇〇7〇】本発明の第1層の基材層としては、上質 紙、クラフト紙、薄葉紙、ケント紙等の紙、アルミニウ ム箔等の金属箔、セロファン、織布、不織布、延伸ナイ ロン、無延伸ナイロン、特殊ナイロン (MXD6等)、 Kーナイロン(ポリフッ化ビニリデンコート)等のナイ ロン系基材、延伸PET、無延伸PET、K一PET、 アルミニウム蒸着PET (VMPET) 等のPET (ポ リエチレンテレフタレート) 系基材、延伸PP (OP P)、無延伸PP(CPP)、アルミニウム蒸着PP、

K-PP、共押出フイルムPP等のポリプロピレン系基材、LDPEフイルム、LLDPE、EVAフイルム、延伸LDPEフイルム、延伸HDPEフイルム、ポリスチレン系フイルム等の合成樹脂フイルム系基材等が挙げられ、これらは印刷されたものでも差し支えない。

【〇〇71】本発明の第川層のパリヤー性材料層は、酸素等の気体類あるいは水蒸気等を遮断して内容物の劣化を防ぐ材料であり、ポリアミドフイルム、ポリエチレンテレフタレートフイルム、ポリビニルアルコールフイルム、アルミニウム蒸着フイルム、アルミニウム箔等の金属箔、エチレン一酢酸ビニル共重合体のケン化物等が挙げられる。特に気体透過性が小さいエチレン一酢酸ビニル共重合体のケン化物が好ましい。これらの材料は前記基材、例えば、アルミニウム蒸着PET(VMPET)、アルミニウム蒸着PPなどのパリヤー性を有する基材と重複しても差し支えない。また、これらの材料と他の基材等の接着性が悪い場合には、オゾン処理、コロナ放電処理、界面活性剤の塗布等の表面処理により二次加工性を高めてもよい。

【0072】本発明の積層体とは、前記基材層からなる 第1層と、バリヤー性材料層からなる第11層および特定 のエチレン単独重合体またはエチレンー α ーオレフイン 共重合体組成物のシーラント層からなる第111層を含む 積層体からなるものであり、場合により、基材層とバリ ヤー性材料層との間、またはバリアー性材料層とシーラ ント層との間、さらには基材の外側にポリラミと称され るポリエチレン等のポリオレフィン層やアイオノマー樹 脂、各種のポリオレフィンおよび/またはゴムに不飽和 カルボン酸またはその誘導体をグラフト変性させた酸変 性ポリオレフィン層等の層を設けたりしてもよい。上記 積層体の具体例としては、紙/PEラミ/AI/SS、 紙/PEラミ/AI/PEラミ/SS、紙/酸変性PE /EVOH/SS, K-PP/PE53/AI/SS, Kーナイロン/酸変性PE/EVOH/SS、延伸HD PE/酸変性PE/EVOH/SS、不織布/酸変性P E/EVOH/SS等があげられる(ただし、PEラ ミ:ポリエチレン系樹脂のラミネート層、AI:アルミ ニウム箔、酸変性 PE:無水マレイン酸変性ポリエチレ ン、SS: 本発明のエチレンーαーオレフィン共重合体 組成物からなるシーラント層を示す)。

【0073】本発明の積層体を製造する方法としては、第1層と第11層をドライラミネート成形によって貼り合わせ、該基材の第11層側に第111層をドライラミネートあるいは押出ラミネート成形によって積層する方法、第1層の基材に、第11層をサンド基材としてエチレン系重合体を押出ラミネート成形にて積層した後に、第111層を押出ラミネート成形にて積層する方法、あるいはその際に第11層と第111層の間に接着剤および/またはエチレン系重合体を介在させる方法をはじめ、種々の方法で

行なっても良い。本発明の積層体のシーラント層を、押出ラミネート成形によって成形する場合には、特に制限されるものではないが、特に本発明のエチレン・ α ーオレフィン共重合体においては、モダンマシナリー(株)製90mmが押出機を用い、例えば、実施例に示すように、Tダイ面長900mm、リップギャップ0.8mm、エアーギャップ、120mm、成形樹脂温度270~280℃、冷却ロール温度20℃として成形を行った場合、成形厚み30 μ m、巻取速度60m/minにおけるラミネート膜の幅をTダイの面長から差し引いた長さ(ネックイン)が150mm未満であり、また、ドローダウンとして、成形厚み30 μ mにおける膜割れが起こらない最高巻取速度が140m/min以上を達成することができる。

【 0 0 7 4 】本発明においては、防曇剤、有機あるいは 無機フィラー、酸化防止剤、有機あるいは無機系顔料、 紫外線防止剤、(不) 飽和脂肪酸アミド、(不) 飽和高 級脂肪酸の金属塩等の滑剤、分散剤、核剤、架橋剤など の公知の添加剤を、本願発明の特性を本質的に阻害しな い範囲で添加することができる。

[0075]

【実施例】以下に実施例および比較例に基づいて本発明 を具体的に説明するが、本発明はこれらによって限定さ れるものではない。

【0076】実施例および比較例における試験法は以下のとおりである。

(物性試験方法)

密度 : JIS K6760準拠。

MFR : JIS K6760準拠。

Mw/Mn : GPC (ウオーターズ150型) ODC B 135℃ カラム: 東ソー(株) 製GMMHR-H (S) PS標準試料による検量線法による。

NMR : 日本電子(株)製 GX-270, ODCB 135℃で測定。

【0077】 (ラミネート成形性評価)

ネックイン(NI):押出機の成形条件を30μm厚,60m/minに固定し、基材にラミネートする。そのときの第11(シーラント)層のラミネート膜の幅(W)を測定し、ダイ幅をW0として、次式よりNIを計算する。

$N I = W_0 - W$ (mm)

ドローダウン(DD):成形厚を30μmに固定し、引取 速度を徐々に上げたとき、第3(シーラント層)のラミ ネートフィルムが破れない最高引取速度を測定する。

【0078】(積層体評価法)

突刺試験: JAS 1019Aに準拠した。貫通部は 半径1mmゆの半球状のものを用いた。サンプルのシー ル面側からと、基材側からの両方について、貫通速度1 00mm/minにて、貫通時の荷重を測定した。 低温ヒートシール性: ヒートシール試験器 (テスター産 業 (株) 製)シールバー幅5mm、圧力2kg/cm²でシール温度を5℃刻みで1秒間シール後放冷。シール部を15mm幅に短冊状に切り出し、引張試験機にて300mm/minでシール部を剝離し、その際の荷重が500gとなる温度を内挿により求めた。この温度が低い方が低温ヒートシール性に優れたものである。

ヒートシール強度:前述のヒートシーラーを用い、圧力 2 kg/cm²、シール温度 150℃、シール時間 3秒 でヒートシールした後、放冷した。シール部を 15 mm 幅に短冊状に切り出し、引張試験機にて300mm/mi nでシール部を剥離し、強度を求めた。

ホットタック性 : 前述のヒートシーラーを用い、圧力 2 kg/cm²、シール時間 1. O がでヒートシール し、シール直後、それぞれのフィルムの片端につけた重 り (6 Og×2) 荷重し、ヒートシール部の剥離が完全に止まるまで剥離し、剥離した長さを測定した。この長さが短いほどホットタック性がよい。剥離した長さが 1 Ocm未満の温度の範囲を内挿により求めた。

【0079】(エチレン・αーオレフイン共重合体 A1の製造) 攪拌機を付したステンレス製オートクレーブを窒素置換し精製トルエンを入れた。次いで、1ーヘキセンを添加し、更にエチレンビス(インデニル)ジルコニウムジクロライド(Zrとして0.02mモル)メチルアルモキサン [MAO](MAO/Zr=100 [モル比]の混合溶液を加えた後、80℃に昇温した。次ぎにエチレンを張り込み重合を開始した。エチレンを連続的に重合しつつ全圧を維持して1時間重合を行い、(A1)エチレン・1ーヘキセン共重合体を得た。

- (A1) エチレン・1-ヘキセン共重合体
- (a1)密度=0.907g/cm3
- (a 2) MFR=11g/10min
- (a3)分子量分布(Mw/Mn)=2.4
- . (a4) 組成分布パラメーター (Cb) = 1.05
- (a5) TREFピーク温度=82.9℃

【 0 0 8 0 】 (エチレンー α ーオレフィン共重合体 A 2 の製造)

(固体触媒の調製)窒素下で電磁誘導攪拌機付き触媒調製器(No. 1)に精製トルエンを加え、ついでジプロポキシジクロロジルコニウム(Zr(OPr)2CI2)28gおよびメチルシクロペンタジエン48gを加え、〇℃に系を保持しながらトリデシルアルミニウムを45gを滴下し、滴下終了後、反応系を50℃に保持して16時間攪拌した。この溶液をA液とした。次に窒素下で別の攪拌器付き触媒調製器(No. 2)に精製トルエンを加え、前配A溶液と、ついでメチルアルミノキサン6.4molのトルエン溶液を添加し反応させた。これをB液とした。次に窒素下で攪拌器付き調製器(No. 1)に精製トルエンを加え、ついであらかじめ400℃で所定時間焼成処理したシリカ(富士デビソン社製、グレード#952、表面積300m2/g)1400gを加えた

後、前記B溶液の全量を添加し、室温で攪拌した。ついで窒素ブローにて溶媒を除去して流動性の良い固体触媒 粉末を得た。これを触媒Dとした。

【0081】(試料の重合)連続式の流動床気相法重合装置を用い、重合温度70℃、全圧20kgf/cm²Gでエチレンと1ーヘキセンの共重合を行った。前配触媒Dを連続的に供給して重合を行い、系内のガス組成を一定に保つため、各ガスを連続的に供給しながら重合を行った。生成した共重合体を樹脂成分A2とする。樹脂成分A2の物性は以下に示すとおりである。

(A2) エチレン・1-ヘキセン共重合体

(a1) 密度=0.910g/cm³

(a2) MFR=11g/10min

(a3) 分子量分布 (Mw/Mn) = 2. 6

- (a4) 組成分布パラメーターCb=1.22
- (a5) TREFピーク温度=83.2、96.5℃
- (a6) d-O. OO8 logMFR=O. 902 0DCB可溶分 (%) = 1. $5 < 9.8 \times 10^3 \times (0.9300 - d + 0.008$

【0082】(他のエチレン系重合体)物性値は表2に示した。

- B11 : 高圧法低密度ポリエチレン(MFR=7.
- 0、密度=0.917、日本ポリオレフィン(株)
- 製);LDPE

B12 : 高圧法エチレンー酢酸ビニル共重合体(酢酸ビニル濃度5重量%、MFR=5.0、密度=0.923、日本ポリオレフィン(株)製); EVA

B21 :線状低密度ポリエチレン重合体 (気相法チグラー触媒品、コモノマー: ブテンー1、MFR=7.

0、密度=0.920、日本ポリオレフィン(株)

製);LLDPE

【0083】 [実施例1] 樹脂成分A2のエチレンーα ーオレフィン共重合体および樹脂成分B11のLDPE を重量比で75:25の割合で配合した組成物に対し て、酸化防止剤 0.09 重量部、ステアリン酸カルシウ ム(日本油脂(株)製) 0. 1 重量部を加え、ヘンシェ ルミキサーで約30秒間均一に混合した後ペレット化 し、組成物C1を得た。第1層として52.3g/cm3 の上質紙を基材とし、第11層をサンド基材として7μm 厚のアルミニウム箔を用い、B11のLDPEを樹脂温 度300~315℃、厚さ15 µmで押出サンドラミネ ートした。この積層体のアルミニウム箔側にさらに第11 I層として、組成物C1を樹脂温度280~290℃、 厚さ30μmでラミネートして最終的な積層体を得た。 次に引取速度を60m/minとし、ネックイン(N 1) を測定し、その後さらに速度を上げ、ドローダウン (DD) を測定した。評価結果を表1に示した。 【0084】 [実施例2] 第11層、サンド基材として厚 さ15μmのEVOHフィルムを用い実施例1と同様の

操作を行った。評価結果を表1に示した。

【0085】 [実施例3] 樹脂成分A10エチレンー α ーオレフィン共重合体、樹脂成分A20エチレンー α ーオレフィン共重合体、樹脂成分B120EVAを、重量比が各々30、40、30となるように配合し、それに対して酸化防止剤0.09重量部、ステアリン酸カルシウム(日本油脂(株)製)0.1重量部を加え、ヘンシェルミキサーで約30秒間均一に混合した後ペレット化し、組成物C2を得た。第I 層として52.3g / cm^3 の上質紙を基材とし、第I 層をサンド基材として7 μ m 厚のアルミニウム箔を用い、B110 L D P E を樹脂温度300~315 C、厚さ15 μ m で押出サンドラミネ

1のLDPEを樹脂温度300~315 $^{\circ}$ でで、イソシアネート系アンカーコート剤(大日精化工業製、3600 A/B;配合比7:3)を用いて厚さ15 $^{\mu}$ mで押出ラミネートした。このLDPE面に、さらに第111層として組成物C2を樹脂温度280~290 $^{\circ}$ C、厚さ15 $^{\mu}$ mでラミネートして最終的な積層体を得た。評価結果を表1に示した。

[実施例4] 第 I 層の基材として 15μ m厚の 2 軸延伸ナイロンを用いた以外は、実施例 3 と同様の操作を行った。評価結果を表 1 に示した。

【表 1 】

ートした。この積層体のアルミニウム箔側にさらにB1							
		•	単位	実施例1	実施例 2	実施例3	実施例 4
4	層	第1層		上質紙	上質紙	上質紙	ナイロン
		その他	_	B 1 1	B 1 1	B 1 1	B 1 1
	標	第11階	<u> </u>	アルミ箱	EVOH	アルミ箔	アルミ箱
	成	その他	-	_		B 1 1	B 1 1
	,рх,	第亚層		C 1	Cl	C 2	C 2
	第Ⅲ	NI 30 mm 60m/min	ms/800ss	6 8	6 8	_	
	層	DD 30μ =	m/min	> 2 0 0	> 2 0 0	_	
	突集	斯 基材傷 ケール側	g f g f	6 5 0 5 9 0	9 0 0 7 8 0	5 7 0 4 8 0	1010
	低温シール性 シール強度		٣	133	133	1 3 5	130
			kgf/15mm	2. 6	3. 1	2. 9	2. 2
	* *	ァトタック	٣	171~	170~	170~.	165~

[比較例1] 第1層として52.3g/cm³の上質紙を基材とし、第11層をサンド基材として7μm厚のアルミニウム箔を用い、B11のLDPEを樹脂温度300~315℃、厚さ15μmで押出サンドラミネートした。この積層体のアルミニウム箔側にさらに第111層として、B11のLDPEを樹脂温度300~315℃で、イソシアネート系アンカーコート剤(大日精化工業製、3600A/B;配合比7:3)を用いて厚さ30μmで押出ラミネートして、積層体を得た。評価結果を表2に示す。突刺強度、低温シール性、ヒートシール強度、ホットタック性およびドローダウン(DD)が120m

/minと劣るものであった。

【0086】 [比較例2] 樹脂成分C2の代わりに樹脂成分B12のEVAとした以外は実施例3と同様の操作を行った。評価結果を表2に示す。表2から、低温ヒートシール性は良いものの、突刺強度、ヒートシール強度が劣ることがわかる。

[比較例3] 樹脂成分C1の代わりに樹脂成分A2単独 とした以外は実施例1と同様の操作を行った。評価結果 を表2に示す。ネックイン、ドローダウンが劣るもので ある。

【表2】

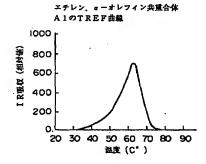
		単位	比較例1	比較例2	比較例3
層	第1程		上質紙	上質紙	上質紙
_	その他	_	B 1 1	B 1 1	B 1 1
構	第1日		、アルミ箔	アルミ指	アルミ箔
或	その他	_		B 1 1	
	第四周		- B11 B12		A 2
第一面	NI 30 # E	mm/900mm	4 0	_	163
層	DD 30 µ m	m/min	120		5 5
突射		g f g f	4 1 0 3 2 0	4 0 0 2 9 0	6 8 0 6 0 0
低温シール性		25	1 4 2	1 3 3	1 3 3
シ	ール強度	kgf/15mm	1.0	0.9	2. 8
赤:	ァトタック	τ	182~	170~	170~

※ボットタック性は250℃まで額定した。

[0087]

【発明の効果】本発明の積層体は、衝撃強度、低温ヒートシール性、ヒートシール強度、夾雑物ヒートシール性等のヒートシール特性、ホットタック性、突刺強度等が良好であり、さらに、成形時のネックイン、ドローダウン(延展性)等の成形性に優れるものである。また樹脂成分の内容物への溶出が少なく、例えば、漬物、乳製品、レトルト食品あるいは冷凍食品、調味料、菓子などの食品あるいは衣類などの各種包装材、各種液体輸送用

【図1】



包材等に好適に用いられるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】エチレン・αーオレフィン共重合体 (A1) についての、連続昇温溶出分別法による溶出温度ー溶出量曲線を示すグラフである。

【図2】エチレン・αーオレフィン共里合体 (A2) についての、連続昇温溶出分別法による溶出温度 - 溶出量曲線を示すグラフである。

【図2】

